

Precision Measuring
Metallographic Analysis

量測 · 金相 · 實驗室設備

Vision Measuring Instrument

2.5D 手動影像量測儀

產品特點：

- 1、多種形式光源，保證滿足多樣性測量要求
- 2、多種數據處理、顯示、輸入、輸出功能
- 3、工件擺正功能，免除工件擺正不易之困擾
- 4、激光指示器專利技術方便對焦和定位
- 5、腳踏開關與軟體配合，操作更簡便
- 6、可外接光學尺顯示器（選配）

選配：



儀器型號MODEL	M-1510	M-2010	M-2515	M-3020	M-4030
工作台載放面積 Stage size	354×228mm	404×228mm	450×280mm	500×330mm	606×466mm
載物台移動型 XY movement	150×100mm	200×100mm	250×150mm	300×200mm	400×300mm
機台重量(KG) Weight	100	110	120	140	240
機台尺寸 (長寬高)mm Device Size	540×560×860		760×600×900		970×670×940
Z軸升降行程(mm) Focus movement	200mm				
工作距離mm Working distance	100mm				
XY座標誤差 accuracy	≤ (3+L/200)um L:長度單位				
光源系統 Light source	上光源LED、下光源LED·亮度可調整				
電源 POWER	AC100-240V 50/60Hz				
影像系統 Optical system	ZOOM LENS 連續變倍遠心鏡頭 0.7X-4.5X 彩色攝影機CCD 放大倍率23X-150X				

Vision Measuring Instrument

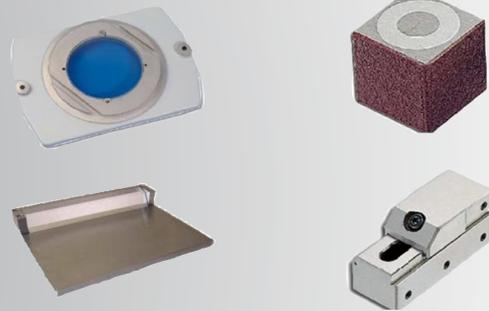
2.5D 半自動影像量測儀



產品特點：

- 1、程控恆流驅動式八區段表面光源打光
- 2、鐳射指示器尋找測量工件具體測量位置
- 3、高度輔助測量
- 4、T型槽工作台，方便各種治具安裝
- 5、腳踏開關與軟體配合，操作更簡便
- 6、Z軸三種速度模式選擇對焦

選配：



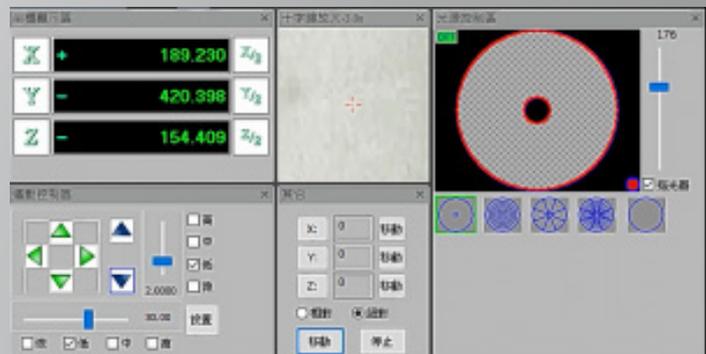
儀器型號MODEL	M-3020MZ	M-4030MZ
工作台載放面積 Stage size	500×330mm	606×466mm
載物台移動型 XY movement	300×200mm	400×300mm
XYZ顯示精度	0.5um	
Z軸升降行程	150mm (Z軸自動對焦)	
影像系統	攝影機：彩色1/3"CCD 鏡頭變倍：0.7X-4.5X	
	放大總倍率：33X-195X 視野範圍FOV：8.1mm-1.3mm	
機台重量(KG) Weight	168KG	266KG
機台尺寸	760×600×900mm	970×670×940mm

Vision Measuring Instrument

2.5D 全自動影像量測儀



- 1、具有快速自動對焦、自動尋邊，強大的編程和自動測量功能
- 2、採用次像素細分技術，提高邊界分辨能力
- 3、配置操縱手柄，亦可軟體程控
- 4、SPC 數據處理分析，大批量治具測量
- 5、三軸伺服控制，定位精度高速度快，運行平穩
- 6、自主開發的控制系統，將所有控制系統於儀器內，穩定性更高
- 7、程控恒流驅動式八區表面冷光光源，可適應複雜的工件測量
- 8、可通過激光指示器尋找被測工件的具體位置，快速定位

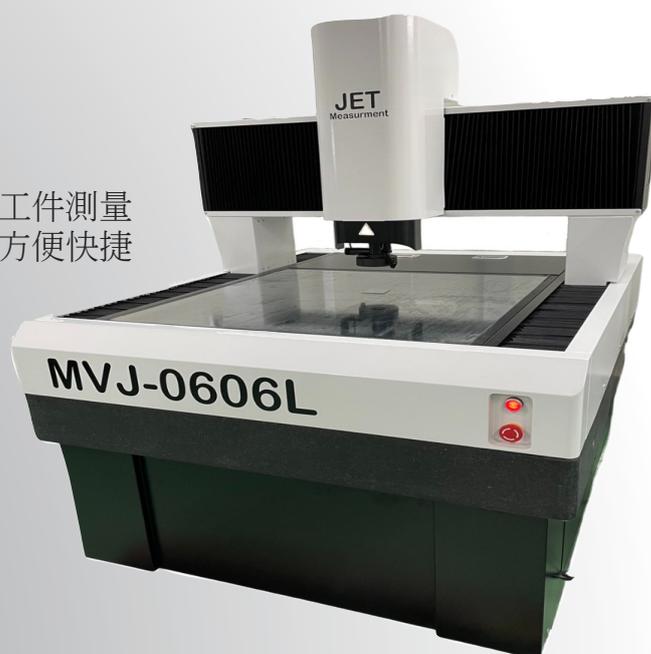


型號MODEL		MVJ-3020CB	MVJ-4030CB
工作台 (STAGE)	載放尺寸(mm)	500×350mm	606×466mm
	移動行程(mm)	300×200mm	400×300mm
XYZ顯示解析度 COUNTER RESOLUTION		0.5um	
驅動控制系統		獨立伺服馬達控制	
XY座標誤差 accuracy		$\leq (3+L/200)\mu\text{m}$ L:長度單位	
光源系統 Light source		上下光源LED光源	
機構尺寸(長寬高)mm SIZE		775×750×1100	923×850×1140
機台重量(KG) WEIGHT		223KG	321KG
Z軸升降行程 Z AXIS MOVEMENT		150mm	
影像系統 OPTICAL SYSTEM		高解析彩色1" CCD 鏡頭倍率：24X-185X FOV：11mm~1.7mm	
電源 POWER		單相AC 220V 50/60Hz	

Vision Measuring Instrument

大行程全自動影像量測儀

- 1、自主開發軟體，可滿足客戶不同測量需求
- 2、具有快速自動對焦、自動尋邊和自動測量功能
- 3、採用次像素細分技術，提高邊界分辨能力
- 4、配置操縱手柄，亦可軟體程控
- 5、SPC 數據處理分析，大批量治具測量
- 6、三軸伺服控制，定位精度高速度快，運行平穩
- 7、自主開發的控制系統，將所有控制系統集成於內部
- 8、程控恒流驅動式八區表面冷光光源，可適應複雜的工件測量
- 9、通過指示器尋找被測工件的具體位置，快速定位，方便快捷



型號MODEL		MVJ-0606L	MVJ-0810L	MVJ-0813H
工作台 (STAGE)	玻璃台尺寸(mm)	700×1190mm	900×1588mm	900×1588mm
	移動行程(mm)	600×600mm	800×1000mm	800×1300mm
XYZ顯示解析度 COUNTER RESOLUTION		0.5um		0.5um/0.1um選配
示值誤差±Δ		E1xy=(3.5+L/200)um		E1xy=(3.5+L/100)um
機構尺寸(長寬高)mm SIZE		1390×1300×1600	1790×1500×1600	1970×1366×1650
機台重量(KG) WEIGHT		800KG	1300KG	1800KG
Z軸升降行程 Z AXIS MOVEMENT		200mm		
影像系統 OPTICAL SYSTEM		高解析彩色1" CCD 鏡頭倍率：24X-185X FOV：11mm~1.7mm		
電源 POWER		AC 220V 50/60Hz 單相		

Vision Measuring Instrument

量測工具顯微鏡



- 1、Z 軸對焦精度可達 0.001mm
- 2、視場寬闊，可得清晰無閃爍影像
- 3、高精度測量，大測量範圍和高精度，適用於各種測量
- 4、無限遠長距明場金相物鏡，滿足長工作距離的測量要求
- 5、照明裝置（反射 / 透射）可選用高亮度 LED 的照明
- 6、利用可變孔徑光闌進行無衍射觀察測量
- 7、快速移動裝置便於測量工件或測量多工件數量

儀器型號MODEL	SJ3020DS	SJ4030DS
工作台面積(mm) Stage size	466×366	556×466
載物台移動型(mm) XY movement	300×200	400×300
機台重量(KG) Weight	100	250
機台尺寸(長寬高)mm Device Size	580×780×930	680×950×1000
Z軸行程(mm) Focus movement	150mm	
XYZ顯示器 XYZ counter	0.001mm/0.0005mm/0.0001mm (可選配)	
XY座標誤差 accuracy	$XY \leq (2.5 + 0.02L) \mu m$ L:長度單位	
對焦系統 Focus system	手動調焦(標配) Z軸電動手輪,快中慢三檔調速(選配)	
電源 POWER	AC100-240V 50/60Hz	
影像系統 Optical system	明場、暗場、偏光或微分干涉對比觀測選配 可選輔助對焦系統：頭部或照明器FA系統 10X目鏡搭配三眼觀察筒 物鏡：5X、10X、20X、50X(100X及長工作距離選配)	

Vision Measuring Instrument

落地式全自動影像量測儀

- 1、自主開發軟體，可滿足客戶不同測量需求
- 2、具有快速自動對焦、自動尋邊和自動測量功能
- 3、採用次像素細分技術，提高邊界分辨能力
- 4、配置操縱手柄，亦可軟體程控
- 5、SPC 數據處理分析，大批量治具測量
- 6、三軸伺服控制，定位精度高速度快，運行平穩
- 7、自主開發的控制系統，將所有控制系統集成於內部
- 8、程控恆流驅動式八區表面冷光光源，可適應複雜的工件測量
- 9、通過指示器尋找被測工件的具體位置，快速定位，方便快捷



參數/型號		MVJ-5040CB
工作台	載物台尺寸 (mm)	710×610
	玻璃台尺寸 (mm)	560×460
	量測行程 (mm)	500×400
X、Y、Z光學尺解析度		0.5μm
示值誤差		≤3.5 + L/200μm(L：測量長度，單位mm)
影像系統	1"數位彩色攝影機(digital Camera)	
	0.7~4.5×連續變倍遠心鏡頭，總放大倍率18-180X	
	FOV：11.1mm~1.7mm	
	電源：單相 AC220	
外觀尺寸(L×W×H)		1130×950×1660
Z軸升降行程 (mm)		200
儀器重量 (Kg)		400

奈米級 - 白光干涉儀

奈米深度 3D 形狀顯微檢測儀



產品應用：

結合光學顯微系統與干涉物鏡的掃描式白光干涉顯微鏡，不需要複雜光路調整程式，兼顧體積小、奈米解析度、易學易用等優點，可提供最高垂直掃描高度達 $400\mu\text{m}$ 的微三維測量，適合各種材料與微元件表面特徵與微尺寸檢測。

產品特色：

奈米深度 3D 檢測

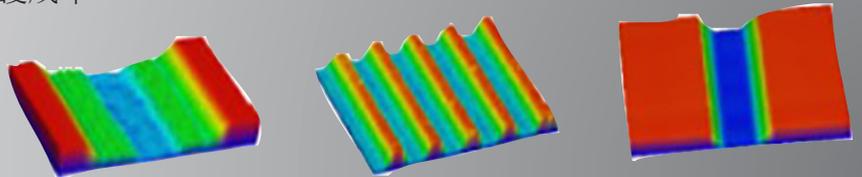
高速 / 無接觸量測

表面形狀 / 剖面高度量測 / Ra、Sa 粗糙度分析

透明 / 非透明材質皆適用

非電子束 / 非激光的安全量測

低維護成本



參數 / 型號		AE100M		
工作台	載物台尺寸 (mm)	150×150		
	量測行程 (mm)	80×60		
干涉物鏡倍率		10X	20X	50X
干涉物鏡FOV(mm)		0.46X0.34	0.23X0.17	0.093X0.069
光學解析度(um)		1.15	0.86	0.62
工作距離(mm)		7.4	4.7	3.4
相機解析度		1600X1200		
Z軸高度量測範圍		100um (選配400um)		
量測解析度		0.1nm		
高度量測重複精度		$\leq 0.1\%$ (量測高度 $> 10\mu\text{m}$) $\leq 10\text{nm}$ (量測高度 $1 - 10\mu\text{m}$) $\leq 5\text{nm}$ (量測高度 $< 1\mu\text{m}$)		
儀器重量 (Kg)		50KG		

Vision Measuring Instrument

微米級 - 白光干涉儀

微米深度 3D 形狀顯微檢測儀

產品特色：

奈米深度 3D 檢測

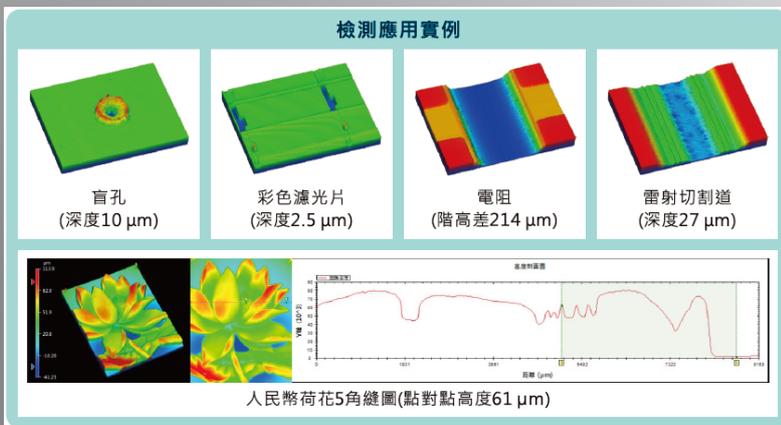
高速 / 無接觸量測 / 高精度縫圖

表面形狀 / 剖面高度量測 / Ra、Sa 粗糙度分析

透明 / 非透明材質皆適用

非電子束 / 非激光的安全量測

低維護成本



參數 / 型號		CSG-3535W		
工作台	載物台尺寸 (mm)	480×430		
	量測行程 (mm)	350×350		
干涉物鏡倍率		10X	20X	50X
干涉物鏡FOV(mm)		0.46X0.34	0.23X0.17	0.093X0.069
光學解析度(μm)		1.15	0.86	0.62
工作距離(mm)		7.4	4.7	3.4
相機解析度		1600X1200		
Z軸高度量測範圍		2000 μm		
量測解析度		0.1μm		
光源波長		高亮度LED 550nm		
儀器重量 (Kg)		480KG		

Vision Measuring Instrument

全自動探針卡調針機



產品特點：

調針機檢測系統—優越的量測結果

0.1um 光學尺，高重複精度，檢出針徑 > 8um、針位偏 > 3um

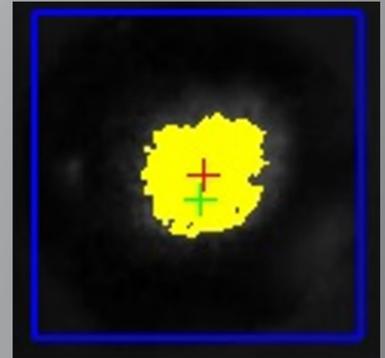
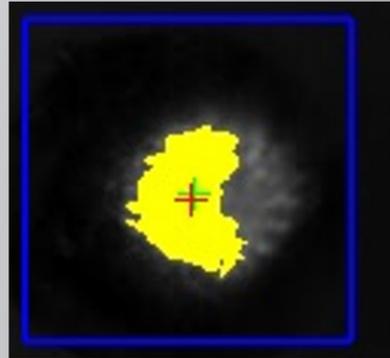
具防撞機制，人員操作時可避免撞卡之風險

智能調針操作，業界調針輔助最快速度，速度可優於 PRVX，較傳統調針時間節省 50% 以上

自動軟體補償校正，可快速校正機台座標以達更精確之量測

人體工學設計的機台，降低人員長時間操作之疲勞感

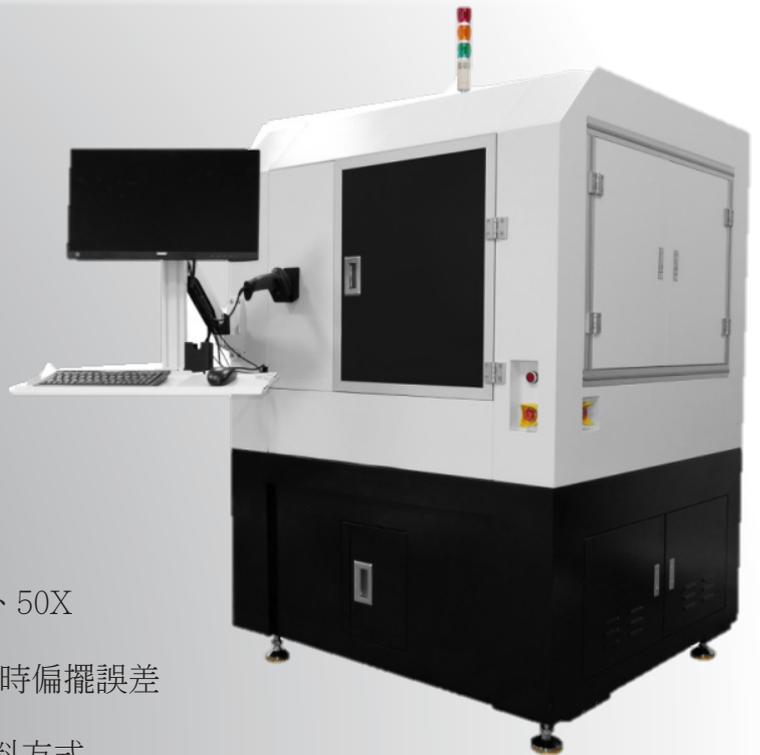
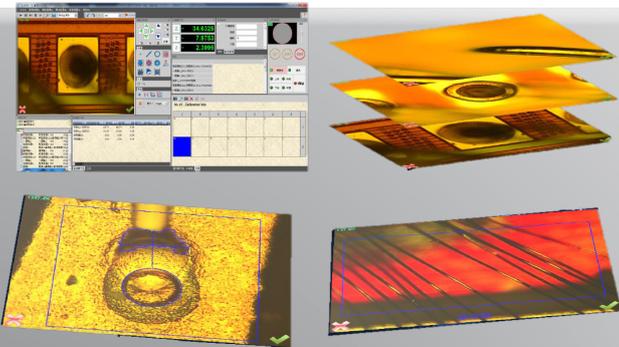
特別製作十卡合一的治具，各尺寸探針卡可準確水平擺正。



機構	花崗石基座及Z軸立柱
光學尺解析度	XYZ三軸光學尺0.1um
運動控制	XYZ採用伺服馬達
XY移動行程	400*300mm
量測範圍	針卡被動元件 < 50mm、針位範圍140*140mm (可依尺寸更新)
量測精度	機台重複性±1um、機台線性精度(2+L/200)um
光學系統	高倍率mapping鏡頭倍率：400x 調針鏡頭倍率：目鏡25X、Zoom 0.8-6X
分辨率	2048*2048
晶片尺寸	1" Global shutter
人體工學距離	物鏡至量測物工作距離90mm 桌子底部至顯微鏡目鏡距離：56cm (目鏡仰角不低於水平)

Vision Measuring Instrument

全自動 AOI 影像量測機



相關應用：

半導體封裝量測 - 焊球尺寸、焊線弧高
載板量測 - 多重座標系建立量測
AOI 影像辨識搜尋座標系

設備特點：

- 1、搭載高解析物鏡配置 5X、10X、20X、50X
- 2、高倍率、高解析、高速量測結果
- 3、具 AOI 特徵辨識功能，修正補償移動時偏擺誤差
- 4、操作簡單，軟體介面優化設定
- 5、全自動化概念，另可針對產品規劃入料方式
- 6、高精度量測 Z: +/- 0.5 μ m、X/Y: +/- 1 μ m

型號		WI5000-SA
移動範圍	X axis	350 mm
	Y axis	300 mm
	Z axis	150 mm
驅動控制		獨立伺服馬達
X/Y-axis 解析度		0.5 μ m
Z-axis 解析度		0.1 μ m
影像系統		CCD：高解析彩色攝像機 物鏡：金相物鏡 物鏡倍率：5X、20X、50 X 顯示放大倍率：136X - 1367X FOV：0.12 - 1.27 mm
光源		LED
重量		1000 kg
尺寸		1200*1300*1820
功率		500 W (不包含電腦、顯示器)
操作電壓		220 V (單向)

Vision Measuring Instrument

OLYMPUS BX53M 顯微鏡



OLYMPUS®

產品特點：

搭配 10 倍目鏡，光學總倍率 50 倍 -1000 倍
優秀的物鏡解析，最小分辨率可達 0.37 μ m
可靈活的擴充模組化，搭配不同的觀察法
適用於各種材料微結構之觀察

本體型號		BX53M-TRF(LED)	BX53M-RF(LED)
光學系統		UIS2 無限遠光學補正	
顯微鏡本體	光路	反射光/穿透光	反射光
	Z焦距	調整行程: 25 mm 一圈微動: 100 μ m 最小微動: 1 μ m	
	樣品載放高度	35 mm (w/o spacer) 最高擴充75 mm	65 mm (w/o spacer) 最高擴充105 mm
觀察視野	廣角FN 22mm	反向:三眼觀察 正向:三眼觀察	
	超廣角FN 26.5mm	反向:三眼觀察 正向:三眼觀察	
Stage 載物台	U-SVRM	同軸左(右): 75mm \times 52mm·扭矩調節 大尺寸同軸左(右): 105mm \times 100mm的·具有在Y軸鎖定機構	
	U-SIC4R2	大尺寸同軸右手柄階段: 50mm \times 100mm的·具有在Y軸的轉矩的調整和鎖定機構	
重量		總重約20.8KG (顯微鏡本體重: 10.3KG)	總重約19KG (顯微鏡本體重: 9.8KG)

Vision Measuring Instrument

NIKON LV150N 顯微鏡



產品特點：

NIKON 顯微鏡主體已模組化，滿足工業顯微鏡的各應用領域，包括半導體器件，封裝，FPD，電子元件，材料和精密模具。

基本規格:	Maximum sample height: 38 mm * 73 mm Z軸焦距行程40mm ' 另可載台高度14mm ' 左右皆可調整焦距 最小微動: 0.1 mm/turn (1 μm/graduation)
接物鏡鼻輪:	ESD Nosepiece
落射光 光路器:	LV-UEPI-N 12V50W 燈屋 Bright/ darkfield 明暗視野切換 · 視野光圈及對比光圈調整
觀察筒	LV-TI3 trinocular eyepiece tube ESD (Erected image, FOV: 22/25) LV-TT2 TT2 tilting trinocular eyepiece tube (Erected image, FOV: 22/25) C-TB binocular tube (Inverted image, FOV: 22) P-TB Binocular Tube (Inverted image, FOV: 22) P-TT2 Trinocular Tube (Inverted image, FOV: 22)
載物台尺寸:	LV-S32 3×2 stage (Stroke: 75 x 50 mm with glass plate) ESD compatible LV-S64 6×4 stage (Stroke: 150 x 100 mm with glass plate) ESD compatible LV-S6 6×6 stage (Stroke: 150 x 150 mm) ESD compatible
目鏡:	CFI eyepiece series
物鏡:	工業顯微鏡 CFI60-2/ CFI60 optical system Objective lens series
Weight:	Approximately 8.6kg

Vision Measuring Instrument

BX7050 金相顯微鏡



產品特點：

目鏡倍率：超廣角高眼點 WF 10x/22(標配)

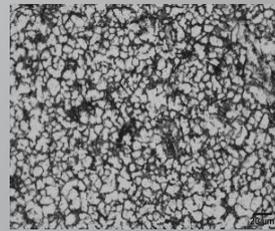
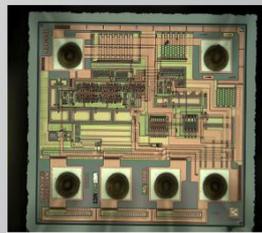
物鏡：5x、10x、20x、50x(100X 選配)

綜合倍率：50x~500x(選配 1000X)

光學系統：無限遠光路

光源：上下光源

第三目可裝置顯微攝錄機，搭配軟體可量測



型號	BX7050(明視野機種)	BX7050BD(明暗視野機種)
鏡筒	三眼式觀察頭(三眼同時觀看免切換)	三眼式觀察頭(三眼同時觀看免切換)
目鏡	超廣角高眼點 WF10x/FN22	超廣角高眼點 WF10x/FN22
物鏡 (明暗視野選配)	無限遠平場消色差 MPL5x NA=0.12 WD: 26.1mm 無限遠平場消色差 MPL10x NA=0.25 WD: 20.2mm 無限遠平場消色差 MPL20x NA=0.40 WD: 8.8mm 無限遠平場消色差 MPL50x NA=0.70 WD: 3.68mm 選配： MPL100x NA=0.85 WD: 0.4mm	無限遠明暗場消色差MPL 5xBD NA=0.12 WD: 9.7mm 無限遠明暗場消色差 MPL10xBD NA=0.25 WD: 9.3mm 無限遠明暗場消色差 MPL20xBD NA=0.40 WD: 7.2mm 無限遠明暗場消色差 MPL50xBD NA=0.70 WD: 2.5mm 選配： MPL100xBD NA=0.85 WD: 0.4mm
綜合倍率	50-500X (100X選配)	50-500X (100X選配)
光源	12v50w 鹵素燈落射光及穿透光可切換	12v50w 鹵素燈落射光及穿透光可切換
電源	110V~220V	110V~220V
載物台行程	75mm*50mm	75mm*50mm
台面尺寸	210mm*140mm	210mm*140mm

Vision Measuring Instrument

MX200 金相顯微鏡

產品特點：
 8*8 吋大行程移動載物台
 工業級高倍顯微鏡
 適合 6" 8" 吋晶圓觀察或面板檢查
 可選配穿透光或晶圓旋轉盤



型號	MX200(明視野機種)
鏡筒	三眼式觀察頭(三眼同時觀看免切換)
目鏡	超廣角高眼點 WF10x/FN22
物鏡 (明暗視野選配)	無限遠平場消色差MPL5x NA=0.12 WD: 26.1mm 無限遠平場消色差MPL10x NA=0.25 WD: 20.2mm 無限遠平場消色差MPL20x NA=0.40 WD: 8.8mm 無限遠平場消色差MPL50x NA=0.70 WD: 3.68mm 選配： MPL100x NA=0.85 WD: 0.4mm
綜合倍率	50-500X (100X選配)
光源	12v50w 鹵素燈落射光及穿透光可切換
電源	110V~220V
載物台行程	200mm*200mm
台面尺寸	240mm*240mm

Vision Measuring Instrument

SZ51/61 TR 立體顯微鏡

OLYMPUS®



產品特點：
 光學變倍 0.67-4.5X
 搭配 10X 目鏡可達 45X 觀察倍率
 另有 15X、20X、30X 目鏡選配
 TR 型號可外接攝影機
 可靠、高性能的光學儀器
 是獲取精確結果的核心，此系列效能卓越
 提供大景深、清晰、細緻而真實的影像

光學系統		Greenough光學系統				
總放大倍率		2.0x-270x [SZ61]*1 2.4x-240x [SZ51]*1				
機身	變焦比	Zoom ratio 6.7 (0.67x-4.5x) [SZ61] Zoom ratio 5(0.8x-4x) [SZ51]				
	觀察筒	雙眼觀察筒 (傾斜角 45°/60°)[SZ61SZ51] 三眼觀察筒 (內建0.5x 照相用鏡片組) [SZ61]				
對焦		機柱對焦裝置				
物鏡	倍率	型式	N.A.	W.D. (mm)	總放大倍率 *2	視野數 (mm)*2
	0.3x	輔助鏡	0.02	350 - 250	2x - 13.5x [SZ61] 2.4x - 12x [SZ51]	φ109.5 - φ16.3 [SZ61] φ91.7 - φ18.3 [SZ51]
	0.4x	輔助鏡	0.027	250 - 180	2.7x - 18x [SZ61] 3.2x - 16x [SZ51]	φ82.1 - φ12.2 [SZ61] φ68.8 - φ13.8 [SZ51]
	0.5x	輔助鏡	0.036	200	3.4x - 22.5x [SZ61] 4x - 20x [SZ51]	φ65.7 - φ9.8[SZ61] φ55 - φ11 [SZ51]
	0.62x	輔助鏡	0.042	160	4.2x - 27.9x [SZ61] 5x - 24.8x [SZ51]	φ53 - φ7.9 [SZ61] φ44.4 - φ8.9 [SZ51]
	0.75x	輔助鏡	0.053	130	5x - 33.8x [SZ61] 6x - 30x [SZ51]	φ43.8 - φ6.5 [SZ61] φ36.7 - φ7.3 [SZ51]
	1x	輔助鏡	0.071	110	6.7x - 45x [SZ61] 8x - 40x [SZ51]	φ32.8 - φ4.9 [SZ61] φ27.5-φ5.5 [SZ51]
	1.5x	輔助鏡	0.1	61	10.1x - 67.5x [SZ61] 12x - 60x [SZ51]	φ21.9 - φ3.3 [SZ61] φ18.3 - φ3.7 [SZ51]
	2x	輔助鏡	0.142	38	13.4x - 90x [SZ61] 16x - 80x [SZ51]	φ16.4 - φ2.4 [SZ61] φ13.8 - φ2.8 [SZ51]
尺寸		194(W)x253(D)x368(H)mm				
重量		3.5 kg (標準配件)				

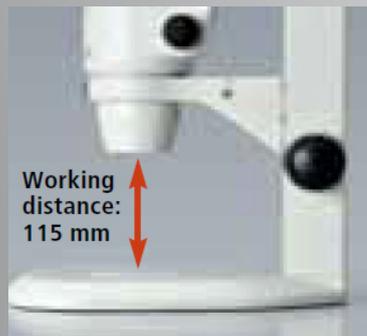
Vision Measuring Instrument

SMZ745 / 745T 立體顯微鏡



產品特點：

SMZ745 / 745T 擁有 7.5 倍變焦並結合了 Greenough 光學系統。0.67 倍至 5 倍的變焦範圍，可提供觀察範圍廣。優秀及卓越的工作距離：以及高變焦比和放大倍數



光學系統	Greenough optical system
光學總倍率	依物鏡及目鏡倍率搭配可達3.35-300x
第三眼規格	內建 C-mount 0.55x (F.N. 11)
目鏡筒	固定式
目鏡觀察角度	45°
Z軸焦距行程	52-75 mm
目鏡 (屈光度調整)	C-W 10xB (F.N. 22), C-W 15x (F.N. 16), C-W 20x (F.N. 12.5) C-W 30x (F.N. 7)
變焦比	7.5:1 (approx)
變焦倍率	0.67-5x
物鏡規格	G-AL 0.5x (W.D. 211 mm), G-AL 0.7x (W.D. 150 mm), G-AL 1.5x (W.D. 61 mm), G-AL 2x (W.D. 43.5 mm)
工作距離	115 mm

Vision Measuring Instrument

SBI45/TR 立體顯微鏡



產品特點：

標準放大倍率 7X~45X

選配輔助物鏡，放大倍率 3.5X~180X

超長的有效工作距離為使用創造足夠的空間

符合人機工程學的結構設計

長時間使用不感疲勞操作方便舒適。

其他搭配模式：



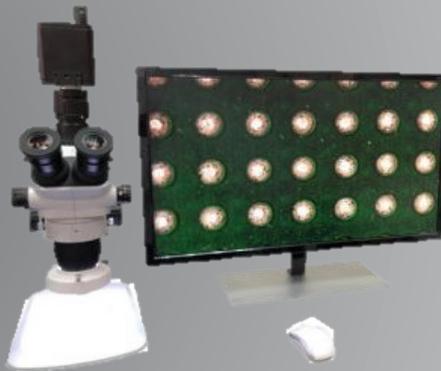
目鏡	高眼點大視野目鏡WF10X/20mm (可安裝測微尺) 可選配15X和20X目鏡
觀察頭	雙目觀察頭部,45°傾斜,可調±5屈光度. 連續變焦0.7X-4.5X 工作距離100mm. 瞳孔眼距範圍54mm-76mm
調焦架	調焦手輪鬆緊可調,升降範圍50mm。
底座	200x255x22mm立柱式平板型底座.
外接光源	環形燈/可調LED燈/光纖照明
其他	精密測量平台、珠寶夾

Vision Measuring Instrument

SZN45/TR 立體顯微鏡

產品特點：

採格里諾光學系統，機構設計簡潔，線條流暢
同時特殊的鍍膜技術造就了優良的光學性能。
標準放大倍率 0.67x — 4.5x；搭配輔助物鏡
最大總倍率 40x — 270x



目鏡	高眼點大視野目鏡PLAN10X/22mm (可安裝測微尺) 可選配15X、20X、30X目鏡
觀察頭	雙目觀察頭部,45°傾斜,可調±5屈光度。 連續變焦0.67X-4.5X 工作距離100mm。 瞳孔眼距範圍54mm-76mm
調焦架	調焦手輪鬆緊可調，升降範圍50mm。
底座	200x255x22mm立柱式平板型底座。
外接光源	環形燈/可調LED燈/光纖照明
其他	精密測量平台、珠寶夾、萬向支架、移動台、CCD